小口径长焦透镜的焦距检测技术

赵磊,白剑*,方卫栋

浙江大学现代光学仪器国家重点实验室,浙江杭州 310027

摘要 基于朗奇-泰伯效应及莫尔条纹技术,利用发散光和不等周期光栅的焦距测量方法被用于小口径长焦透镜的焦距测量。将一块曲率半径存在加工误差的平凹长焦透镜作为待测透镜进行焦距测量。在未知透镜真实曲率半径的情况下,首先计算待测透镜曲率半径误差对焦距检测精度的影响,并确定透镜在整个检测系统中的位置,然后进行透镜焦距实际测量,分别计算多组测量焦距值。通过对比发现,在未知待测透镜曲率半径的情况下,检测焦距的重复性、稳定性均一致,所测焦距均为 33200~33270 mm,且重复性精度高于±0.055%,测量精度优于焦深的1/5。结果充分说明,所提方法对小口径长焦透镜的焦距检测是可靠、有效的。 关键词 测量;发散光;不等周期光栅;小口径;长焦距检测

中图分类号 TH741 文献标志码 A

doi: 10.3788/AOS202040.0412002

Focal Length Measurement Method for Lenses with Small Aperture and Long Focal Length

Zhao Lei, Bai Jian*, Fang Weidong

State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China

Abstract Based on the Ronchi-Talbot effect and moire fringe technique, the focal length measurement method using divergent light and unequal-period grating is used for the measurement of the focal length of lens with a small aperture and long focal length. The long focal length of a plano-concave lens as a lens to be measured with a processing error in the curvature radius is measured. When the true curvature radius of the lens is unknown, first, the influence of the curvature radius error (of the lens to be measured) on the focal length detection accuracy is analyzed, and the position of the lens in the whole detection system is determined. Then, the focal length of the lens is measured focal length values are calculated separately. By comparison, it can be found that when the curvature radius remains unknown, the repeatability and stability of the focal length measurement are consistent. The measured focal lengths are in the range of 33200–33270 mm. The repeatability precision is greater than 0.055%, and measurement accuracy is better than one-fifth of the focal depth. These results prove that the proposed method is reliable and efficient in the focal length measurement of small-aperture lenses with long focal length.

Key words measurement; divergent beam; gratings with different periods; small aperture; long focal-length measurement

OCIS codes 120.4120; 050.1950; 050.1220; 220.4840

1 引 言

作为惯性约束核聚变等大功率激光系统中的重 要组成部件,长焦透镜的各种基本参数需要被精确 测量,其中透镜的焦距参数是否精确已知将直接影 响激光聚焦的效果。长焦透镜也被广泛应用于各种 光学系统中^[1]。由于小口径长焦透镜的数值孔径 小、焦深长并难以精确定焦,焦距的精确测量成为一 个巨大挑战。

由于传统的焦距检测方法,如位移法^[2]、放大率 法^[3],难以实现长焦透镜焦距的精确测量,国内外研 究人员提出了很多种方法对长焦透镜的焦距进行测 量。1999年,Meshcheryakov等^[4]提出在长焦透镜 的焦距测量系统中加入一块高精度的光楔,通过移

收稿日期: 2019-07-25; 修回日期: 2019-08-29; 录用日期: 2019-10-21

基金项目:科学挑战专题(TZ2016006-0502-02)

^{*} E-mail: bai@zju.edu.cn

入、移出光楔,测量像点的偏移距离来计算透镜焦 距。该方法对 25 m 焦距的透镜焦距测量精度达到 了 0.1%,但对入射平行光的准直性以及光楔的加工 精度要求高,焦距检测精度难以进一步提高。2002 年,Parham 等^[5]提出利用移相干涉仪测量焦距,检 测精度可以达到 0.02%,但对球面反射镜加工精度 要求高,而且对不同焦距的待测透镜需要适配不同 的球面反射镜。2009 年,国内的 Zhao 等^[6]提出使 用差动共焦定焦的方法进行大口径透镜的焦距检 测,通过两次定焦,计算出参考镜与待测镜的组合焦 距值,进而计算出待测透镜的焦距值,此方法的焦距 测量精度高于 0.013%,但测量精度依赖于标准参考 透镜,且标准参考透镜加工难度大、价格昂贵。

上述长焦透镜的焦距检测方法虽有较高的精度,但是依赖于关键性部件的加工精度,而且对测量 环境要求高。Yokozeki等^[7-8]提出采用泰伯效应和 莫尔条纹技术进行长焦透镜的焦距测量,此方法对 测量环境要求不高,且精度高于 0.1%。基于此方 法,本课题组对大口径长焦透镜的焦距测量进行了 十多年的研究。2002年,侯昌伦博士等^[9]提出基于 朗奇光栅和泰伯效应结合平行光扫描及子孔径拼接 的方法来检测大口径长焦透镜的焦距。2014年, Luo等^[10]提出基于发散光和不等周期光栅的长焦 距测量法,该方法能够一次性全口径地进行透镜焦 距测量,使用发散光代替平行光缩短了测量光路,使 用不等周期光栅大大提高了检测精度。实验表明, 该方法对焦距的检测精度优于 0.16%,重复性、稳定 性、复现性均优于 0.002%^[11]。

基于发散光和不等周期光栅的焦距测量方法主要用于大口径长焦透镜的焦距检测,尚未考虑将其用于小口径长焦透镜的焦距检测。相对于口径为430 mm的传统大口径长焦透镜,将口径仅为大口径透镜的1/4,也就是102 mm的透镜称为小口径长焦透镜。小口径长焦透镜的数值孔径更小、焦深更长,相比大口径长焦透镜更难以检测。根据物理焦深计算公式,若待测透镜的口径为102 mm,焦距名义值为50 m,其物理焦深可以达到±349 mm。

基于发散光和不等周期光栅的长焦透镜焦距测 量方法能够实现在有限空间进行长焦透镜的焦距测 量,避免了环境空气扰动的影响,利用莫尔条纹角度 求取焦距,避免焦深对焦距测量精度的影响。通过 实验验证本文方法对小口径长焦透镜焦距测量的有 效性。推导出平凹透镜主平面的位置,然后计算曲 率半径的误差对焦距检测的影响,并理论分析了待 测透镜在整个测量系统中的位置;最后对一块口径 为102 mm,焦距名义值为50 m,带有曲率半径加工 误差的平凹透镜进行检测。通过对比,在未知待测 透镜曲率半径的情况下,检测焦距的重复性、稳定性 均一致,充分说明本方法对于小口径长焦透镜焦距 检测是可靠和有效的。

2 小口径长焦透镜的焦距测量原理

2.1 基于发散光和不等周期光栅的长焦透镜的焦 距检测实验原理

基于发散光和不等周期光栅的长焦透镜焦距检测基本原理如图1所示。长焦透镜的焦距检测系统 主要由3个模块组成,即光源模块、光栅模块和图像 采集处理模块。光源模块中波长为1053 nm的红 外激光器的出射光束经数值孔径为0.65 的显微物 镜会聚和小孔滤波后发散为理想球面波。光栅模块 主要由2块周期分别为200 µm和275 µm的朗奇 光栅和1块毛玻璃组成,通过控制2块朗奇光栅之 间的距离使在紧贴光栅G2的毛玻璃上产生莫尔条 纹图像。图像采集处理模块主要包括2块反射镜, 用以转折光路。CCD相机用以采集图像;计算机用 以处理图像,计算待测透镜的焦距。







在测量中,球面发散光经光栅 G1 后会形成一 系列 G1 的泰伯像,在某一泰伯像距离处放置光栅 G2,则光栅 G1 的泰伯像会与光栅 G2 形成莫尔条 纹,如图 2 所示。按照重叠线条交点的轨迹来表示 莫尔条纹的亮度分布。在 XY 直角坐标系中,两光 栅的栅线序数分别用 M、N 表示,则莫尔条纹的序 数 K 值为M-N。图 2 中的连线 I、II、III 的透光面 积最大,形成亮条纹,它们的 K 值为+2、+1 和 0; 而在黑线与亮线交点的连线上,光线互相遮挡形成



图 2 莫尔条纹生成示意图

Fig. 2 Schematic of Moire fringe generation

暗条纹。根据莫尔条纹的生成原理,莫尔条纹与水 平面的角度可以表示为

$$\tan \alpha = \frac{\frac{p_2}{p_1'} - \cos \theta}{\sin \theta}, \qquad (1)$$

式中: p_2 和 p'_1 分别是光栅 G2 和光栅 G1 泰伯像 G1'的周期; θ 是两光栅之间的夹角。根据几何光学 及相似三角原理,泰伯像 G1'的放大率 η 可以表示 为

$$\eta = \frac{p'_1}{p_1} = \frac{f_{\text{wave}} - Z}{f_{\text{wave}}},$$
 (2)

式中: f_{wave}是负值,表示照射到光栅 G1上的发散光的焦距; Z 是光栅 G1 与光栅 G2 的距离,即泰伯距。

根据(1)式和(2)式,可以求出发散光的焦距值 f_{wave}为

$$f_{\text{wave}} = Z + \frac{Z}{\beta(\sin\theta\tan\alpha + \cos\theta) - 1}, \quad (3)$$

式中:α 是莫尔条纹与水平面之间的夹角;θ 是两光 栅之间的夹角;β 是光栅 G1 与光栅 G2 的周期比。 β 可表示为

$$\beta = \frac{p_1}{p_2} \,. \tag{4}$$

将被测透镜放入光路中,此时照射到光栅 G1 上的光束的焦距为发散光源与透镜所组成的光学系 统的组合焦距,将其定义为 f com,移动光栅 G2 来获 得新的泰伯距离 Z',此时组合焦距的焦距公式可 以表示为

$$f_{\rm com} = Z' + \frac{Z'}{\beta(\sin\theta\tan\alpha + \cos\theta) - 1}, \quad (5)$$

式中:Z[']是光栅 G1 和光栅 G2 之间的距离,也就是 放入被测透镜后的泰伯距离,如图 3 所示。此外,通 过透镜组合公式可以得到被测透镜的焦距。前后表 面 V1、V2 的主平面位置 H1 和 H2 可以表示为





式中: $l_{\rm H}$ 是物方主平面距离前表面的距离; $l'_{\rm H}$ 是 像方主平面距离后表面的距离; d_0 是被测透镜的 中心厚度; d_2 是被测透镜后表面与光栅 G1 之间的 距离; r_1 、 r_2 分别是透镜前后表面的曲率半径;n 是 透镜的折射率; d_1 是透镜前表面到光栅 G1 的距 离。结合(5)式和(6)式,测量透镜的焦距可以表 示为

$$f_{\rm lens} = 1 / \left(\frac{1}{f_{\rm com} + d_2} - \frac{1}{l_0 + d_1 - l_{\rm H}} \right) .$$
(7)

基于发散光和不等周期光栅的小口径长焦透 镜的焦距测量原理

传统的基于发散光和不等周期朗奇光栅的焦 距检测系统主要是针对于弯月形大口径透镜的焦 距检测。针对小口径平凹透镜的焦距检测,需要 重新计算确定主平面的位置以及透镜在整个测量 系统中的合适位置。平凹透镜光学系统示意图如 图 4 所示。







针对平凹透镜,(6)式需要修改为

$$\begin{cases} l_{\rm H} = 0 \\ l'_{\rm H} = -\frac{d_{\,0}}{n} \\ d_{\,2} = d_{\,1} - d_{\,0} - l'_{\rm H} \end{cases}$$
(8)

从(8)式可以看出,平凹透镜主平面的位置与透 镜的曲率半径无关。通过(7)式与(8)式可知,曲率半 径的测量误差不会影响焦距的实际测量。

为了实现小口径光学透镜焦距的全口径测量以 及提高采集图像中有效莫尔条纹的数量,需要将透 镜放置于合适的位置。光源模块能够在距离点光源 4000 mm 处形成口径为 610 mm 的理想球面波,实 现对口径为 430 mm×430 mm 的被测方形透镜的 焦距检测。为了实现口径为 102 mm 的待测圆形透 镜的小口径照明,根据相似三角形原理,需要使被测 透镜与点光源之间的距离大于 671 mm。

在焦距测量系统中加入待测透镜后,泰伯像 G1 的放大率 η 可以表示为

$$\eta = \frac{p'_1}{p_1} = \frac{f_{\rm com} - Z}{f_{\rm com}},$$
(9)

结合(7)式变形推导得知,当被测透镜焦距在 10~ 50 m 内时,待测透镜离光源越近,组合焦距越小,光 栅 G1 的使用面积越大,泰伯像 G1'的放大率越大, 采集的图像中有效莫尔条纹数量越多,越有利于透 镜焦距的精确测量。因此在保证能够实现全口径照 明的情况下,应尽可能缩短点光源到待测透镜的 距离。

3 实验及结果

3.1 小口径长焦透镜的焦距测量实验

搭建图 5 所示的实验系统,待测透镜使用夹具 固定,通过电子自准直仪调整待测元件的姿态,使待 测透镜与整个测量系统共轴并垂直于光轴,其中待 测透镜距离点光源 820.5 mm。



图 5 长焦距检测系统的装置图 Fig. 5 Photograph of long focal-length testing system

为了得到清晰的莫尔条纹图像,需要调整光栅 G2的最佳测量位置,理论上光栅G2的最佳测量位 置即光栅G2位于光栅G1的泰伯自成像的某个周 期位置处。在之前的研究中,当最佳测量位置处所 形成的莫尔条纹倾角为光栅G1和光栅G2夹角的 1/2时,焦距测量的精度最高^[12]。在移动光栅G2 位置过程中,莫尔条纹先密集后稀疏,莫尔条纹的倾 角从大变小,如图6所示。



图 6 最佳测量位置附近的莫尔条纹。(a)最佳位置前;(b)最佳位置;(c)最佳位置后 Fig. 6 Moire fringes near optimal measuring position. (a) Before optimal measuring position; (b) at optimal measuring position; (c) after optimal measuring position

3.2 实验结果

本次实验对一块焦距为 50 m,曲率半径带有 加工误差的平凹透镜进行检测。透镜参数如表 1 所示。分别改变凹面的曲率半径值进行三次焦 距检测,检测焦距具体值如表 2 所示,其中 f 为 测量的焦距值, \overline{f} 为 8 次测量焦距值的平均值, Δf 为测量的焦距值与 8 次测量焦距值的平均值 的差值。 从表 2 可知, 焦距检测时, 当输入不同的曲率半径时, 测量的焦距值均一致, 这也验证了平凹透镜曲率半径的测量误差不会影响焦距测量, 这与理论推导结果一致。而且三次测量焦距的重复性都优于±0.055%。

这里,以测量值的平均值为参考值,待测透镜的 焦深为±154.2 mm,测量精度优于焦深的1/5,基于 此,认为测量的结果是准确、可靠的。

Table 1 Parameters of lens to be tested

Refractive index		Central thickness d_0/m	m $r_{1}/$	r_1/mm		Aperture D / mm
1.	45	8.723	-2	-25000		102
		表 2 不	同曲率半径下焦	距测量的对比		
		Table 2 Comparison of f	ocal-length test v	vith different curv	ature radiuses	
N-	$r_1 = -16800 \text{ mm}$		$r_1 \!=\! -17000 \mathrm{mm}$		$r_1 = -25000 \text{ mm}$	
INO.	f/mm	$\Delta f/ar{f}$	f / mm	$\Delta f/ar{f}$	f /mm	$\Delta f/ar{f}$
1	-33216.2	0.0080%	-33243.3	-0.0273%	-33212.4	-0.0531%
2	-33210.0	-0.0107%	-33262.9	0.0317%	-33240.6	0.0317%
3	-33219.9	0.0191%	-33262.8	0.0314%	-33221.6	-0.0254%
4	-33222.1	0.0257%	-33250.2	-0.0065%	-33247.2	0.0516%
5	-33203.8	-0.0294%	-33243.5	-0.0267%	-33212.3	-0.0534%
6	-33222.8	0.0279%	-33246.7	-0.0170%	-33228.3	-0.0053%
7	-33203.8	-0.0294%	-33268.9	0.0497%	-33237.5	0.0224%
8	-33209.8	-0.0113%	-33240.6	-0.0354%	-33240.5	0.0314%
\overline{f}		-33213.5		-33252.4		-33230.6

4 结 论

详细介绍了基于发散光和不等周期光栅的焦距 测量方法,并将该方法用于小口径长焦透镜的焦距 检测中。推导了平凹透镜主平面的位置,从理论上 论证了曲率半径的测量误差不会影响平凹透镜焦距 的测量,并通过实验验证了。此外,推导了小口径待 测透镜在整个系统中的位置,并通过实验验证了本 文方法对小口径长焦透镜焦距测量的有效性。对一 块口径为102 mm,焦距为50 m,带有曲率加工误差 的平凹透镜进行检测。通过对比可知,在未知待测 透镜曲率半径情况下,检测焦距的重复性、稳定性均 一致,所测焦距均为 33200~33270 mm,且单次测 量的重复性精度优于±0.055%,测量精度优于焦深 的1/5。结果充分说明,本文方法对小口径长焦透 镜的焦距检测是可靠、有效的。

参考文献

- [1] Chen W, Liang Z C, Ge L, et al. Micro-optics label system based on six-reflection fold annular aperture lens[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2017, 54 (6): 062201.
 陈伟,梁忠诚,戈兰,等.基于6次反射环形孔径透镜的微光学标签系统[J].激光与光电子学进展, 2017, 54(6): 062201.
- [2] Ma X K. Error analysis of measuring focal length of

convex lens by object-image interchange method [J]. Physics Experimentation, 1989, 9(6): 258-260. 马兴坤. 物象互换法测凸透镜焦距的误差分析 [J]. 物理实验, 1989, 9(6): 258-260.

- [3] MuGG, Zhan YL. Optics [M]. Beijing: People's Education Press, 1978.
 母国光, 战元令. 光学 [M]. 北京:人民教育出版社, 1978.
- [4] Meshcheryakov V I, Sinelnikov M I, Filippov O K. Measuring the focal lengths of long-focus optical systems[J]. Journal of Optical Technology, 1999, 66(5): 458-459.
- [5] Parham T, McCarville T J, Johnson M A, et al. Focal length measurements for the national ignition facility large lenses [C]//Optical Fabrication and Testing, June 3-5, 2002, Tucson, Arizona, United States. Washington, D.C.: OSA, 2002: OWD8.
- [6] Zhao W Q, Sun R D, Qiu L R, et al. Laser differential confocal ultra-long focal length measurement [J]. Optics Express, 2009, 17 (22): 20051-20062.
- [7] Yokozeki S, Kusaka Y, Patorski K. Geometric parameters of moiré fringes [J]. Applied Optics, 1976, 15(9): 2223-2227.
- [8] Nakano Y, Murata K. Measurements of phase objects using the Talbot effect and moiré techniques [J]. Applied Optics, 1984, 23(14): 2296-2299.
- [9] Hou C L, Bai J, Hou X Y, et al. The measurement of long focal length based on Talbot effect of Ronchi grating

[J]. Acta Optica Sinica, 2002, 22(11): 1328-1330. 侯昌伦,白剑,侯西云,等.基于龙基光栅塔尔博特 效应的长焦距测量[J].光学学报, 2002, 22(11): 1328-1330.

- [10] Luo J, Bai J, Zhang J C, et al. Long focal-length measurement using divergent beam and two gratings of different periods [J]. Optics Express, 2014, 22 (23): 27921-27931.
- [11] Luo J. Study on large-aperture lens detection

techniques based on wavefront sensing [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2016. 罗佳. 基于波前传感方法的大口径透镜检测技术研 究[D]. 杭州:浙江大学, 2016.

[12] Jin X R. Calibration methods for long focal-length measurement with Talbot interferometry [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2013.
金晓荣.基于 Talbot 效应的高精度长焦距检测系统 的校准方法[D].杭州:浙江大学, 2013.